

# KOHエッチング装置

## (型式:ETC-8001CE)

SiCウエハやGaNウエハ等の熔融KOHによるエッチング処理を安全かつ精密に!!  
基板カゴにウエハをセットし、エッチング開始ボタンを押すだけ

### 【装置コンセプト】

- 操作時の安全性 (CE準拠)**  
 人が直接KOH雰囲気には接しない  
 低温環境でのサンプル取り出しが可能  
 各種インターロック装備
- メンテナンス時の安全性**  
 安全にルツボ交換が可能
- エッチングの制御性**  
 液温制御化による温度制御性の向上
- 完全自動化**  
 レシピ作成により、全工程の自動化

### 【適用】

- ウエハ表面欠陥評価
- ウエハ表面処理

### 【仕様表】

型式	ETC-8001CE
ルツボサイズ	Φ250×H190 (t2)
対応ウエハサイズ	8インチ
最高加熱温度 (加熱炉用熱電対値)	700℃
温度安定性 (制御用熱電対値)	±1℃
基板カゴ上下機構	自動
ロードロック室	有り
基板カゴ回転機構	モータ駆動 (Max. 10rpm)
ルツボ蓋用シャッター機構	自動
液温測定用熱電対上下機構	自動
電力	単相200V 40A
排気ダクト径	Φ100 (※筐体内排気設備をご準備ください)
装置サイズ (筐体)	W1550×D950×H1700
装置重量	500kg

